

可程式恆溫恆濕試驗系統

Programmable Compact Temperature & Humidity System

系統簡介:

考量晶片於不同溫度、溼度下之電性特性需求，故本中心南區實驗室增設可程式恆溫恆溼系統，以進行晶片環境溫度控制及量測驗證。



運行畫面



運轉顯示



曲線顯示



程式設定



運轉設定



系統設定

儀器規格型號:

1. 可程式化溫度範圍： $-40^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$
2. 可程式化濕度範圍： $10\% \sim 98\text{RH}$
3. 升溫速度($-40^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$) $\leq 60\text{mins}$ 、降溫速度($20^{\circ}\text{C} \sim -40^{\circ}\text{C}$) $\leq 45\text{mins}$ 。
4. 溫度穩定度 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 、濕度穩定度 $\pm 2.5\text{RH}$ 、內部容積 100 公升、測試孔直徑 5cm 圓孔壹孔。
5. 可程式控制器：
 - A. 可程式多段溫度區間調整 200 段、可程式記憶 1000 組。

B. 可紀錄及顯示溫度、濕度量測曲線、並可匯出溫濕度曲線資料。

C. 具備觸控螢幕、USB 資料匯出介面及 RS-232 通訊介面。

D. 溫度設定解析度 $\leq 0.01^{\circ}\text{C}$ 、濕度設定解析度 $\leq \pm 0.1\%RH$ 。

6. 提供電源供應器 Agilent E3631A、數位電表 Agilent 34401A 各一台，若有其他儀器需求，請一併預約其他系統協同量測。

服務項目:

可程式溫溼控櫃。

注意事項:

進溫控櫃之待測物相關物件需能耐所欲控制之溫濕度！

儀器維護者:

劉先生 (06)208-7971#7109 cyliu@narlabs.org.tw